

CIGS膜の結晶粒評価

SEMによる結晶方位解析

測定法 : EBSD・SEM
 製品分野 : 太陽電池
 分析目的 : 構造評価・形状評価

概要

CIGS薄膜多結晶太陽電池は低コスト化・大面積化・高品質化を期待されている次世代の太陽電池として開発が進められており、その際に結晶情報が必要とされています。EBSD法ではCIGS膜の結晶粒評価が可能です。

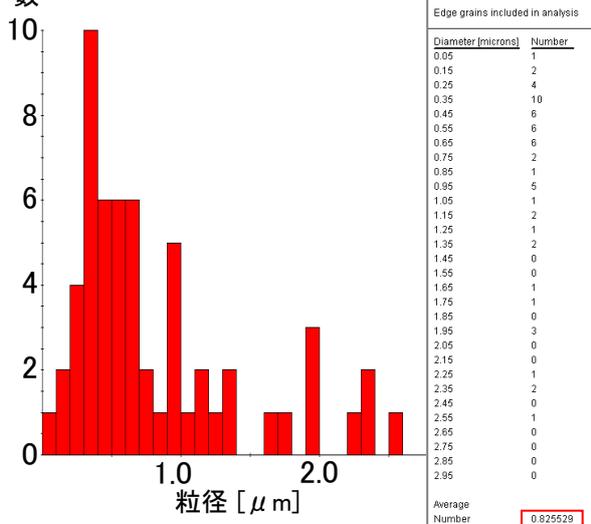
EBSD法で得られる結晶情報は主に配向性・結晶粒径などです。

データ

加工断面の反射電子像



結晶粒径分布

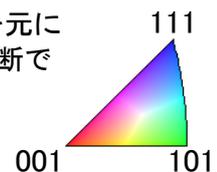


平均粒径0.83 [μm]

逆極点図方位マップ



※Unit Triangle(右図)を元にマップ内の方位が判断できます。



サンプルご提供 東京工業大学 山田明研究室

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : http://www.mst.or.jp/